

采购清单

采购单位	西安理工大学			备案函号	ZCBN-省本级-2026-07997		
项目名称	多靶磁控溅射镀膜机						
政府预算资金	¥ 680,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
单位资金	¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他电工、电子生产设备	多靶磁控溅射镀膜机	680,000.00	1	套	680,000.00	支持金属材料、氧化物材料、半导体材料的溅射镀膜。设备采用镀膜室+送取样室的双腔室结构，配置三只溅射靶以满足制备多层薄膜材料的要求，配备一只离子源，用于样片表面的清洗和活化。Φ6英寸样片镀膜不均匀性小于±5%；基片控温范围超过500°。
2							
3							
4							
5							